

國立成功大學基礎研究核心設施共同使用服務計畫 論文質化成果回饋獎勵方案

更新日期：114/03/14

為因應國科會計畫轉型變革，我們從 110 年度起，為您制定了「論文質化成果回饋獎勵方案」。以使用者年度研究質化成果作為來年回饋獎勵之依據，使用儀器的成果越多，回饋越多！我們與您攜手共創雙贏局面！

依國科會基礎研究核心設施預約服務管理系統(下稱預約系統)所填報之學術績效，制定質化成果種類及回饋獎勵措施如下表：

獎勵標準	儀器專家或技術員 並列於作者群*	致謝**	備註
Impact factor < 5 或 Ranking > 10%	獎勵：10 點	獎勵：2 點	*列於作者群者需有實質貢獻。 **指致謝欄、材料與方法或內文中提及對該儀器、服務中心致謝詞之情形， 致謝詞請參考範例 。
Impact factor ≥ 5 或 Ranking ≤ 10%	獎勵：25 點	獎勵：5 點	

- **學術績效資料來源**：預約系統報表，於每年年初下載本計畫前一年度報表，經審核確認填報無誤者，依上表之獎勵標準得出每篇成果之獎勵點數。
- **獎勵點數計算**：以計畫主持人為單位，加總每篇成果點數後得出每人點數，再將每人點數加總得出本計畫前一年度學術績效總點數。
- **回饋獎勵金計算**：提撥本計畫前一年度的服務總收入部分金額(上限 10%)，除以前一年度學術績效總點數，得出每一點學術績效可換算之金額，換算成每位計畫主持人的回饋獎勵金。
- **回饋獎勵金使用**：可折抵實驗已完成之儀器使用費，年度及儀器不限。由計畫主持人自行決定使用與否，以及要折抵之預約序號。請將折抵資訊 e-mail 至本方案聯絡人，由專人與您聯絡協助進行折抵作業。
- **舉例說明**：計畫主持人於預約系統登錄之 109 年已發表成果中共有 3 篇提及本計畫儀器貢獻，其中有一篇 IF<5 的致謝，一篇 Ranking<10%的致謝以及一篇 IF>5 的列於作者群，則計畫主持人 109 年之學術績效點數為 2 點 +5 點+25 點=32 點。本計畫 109 年度學術績效總點數為 8,100 點，提撥服務總收入 100 萬做為回饋獎勵金，可得每點約為 123 元，則該計畫主持人可獲得回饋獎勵金為 32 點 X123 元=3,936 元整。
- **本方案執行單位**：國立成功大學核心設施中心貴重儀器設備組
- **本方案聯絡人**：宋宜樺小姐，e-mail：em61351@ncku.edu.tw
TEL：06-2757575#31370 或直撥 06-2383620

致謝的內容可參考以下範例，請以致謝儀器 ID 及計畫編號為主：

The authors gratefully acknowledge the use of 儀器 ID of 計畫編號 belonging to the Core Facility Center of National Cheng Kung University.

另檢附儀器 ID 對照表，及近 3 年計畫編號清單：

近 3 年計畫編號清單	
年度	計畫編號
114	NSTC 114-2740-M-006-001
113	NSTC 113-2740-M-006-002
112	NSTC 112-2740-M-006-001

儀器 ID 對照表		
流水號	儀器名稱	儀器 ID
1.	元素分析儀	EA000600
2.	分析型場發掃描式電子顯微鏡	EM000600
3.	多功能環境場發掃描式電子顯微鏡	EM000700
4.	高解析穿透式電子顯微鏡	EM000800
5.	高解析穿透式電子顯微鏡-液態樣品	EM000800A
6.	高解析掃描電子顯微鏡	EM003600
7.	前瞻聚焦離子束系統	EM025200
8.	多功能低電壓穿透式電子顯微鏡	EM025800
9.	掃描探針顯微鏡-掃描電化學	EM025900
10.	超高解析掃描式電子顯微鏡	EM026200
11.	化學分析電子光譜儀-ESCA(XPS)	ESCA000200
12.	X 光光電子能譜儀-XPS	ESCA003700
13.	氫液化系統	HLS000100
14.	高解析感應耦合電漿質譜分析儀	ICP000400
15.	高解析氣相層析飛行質譜儀	MS000400
16.	高解析 Orbitrap 質譜儀串聯液相層析暨晶片電泳分析系統	MS004000
17.	固態核磁共振光譜儀	NMR000800
18.	600MHz 核磁共振儀	NMR001900
19.	超導核磁共振儀 500NMR	NMR005000
20.	AVIII HD 700MHz 高磁場超導核磁共振儀	NMR005700
21.	瞬態吸收光譜儀	OTHER003700

儀器 ID 對照表		
流水號	儀器名稱	儀器 ID
22.	電子束蒸鍍薄膜沉積系統	SEMI004100
23.	感應耦合式高密度電漿蝕刻機	SEMI004200
24.	電子束微影系統	SEMI004300
25.	超導量子干涉磁化儀	SQUID000200
26.	超導量子干涉磁化儀-高壓量測服務	SQUID000200A
27.	物理性質量測系統儀	SQUID001200
28.	物理性質量測系統儀-高壓電性量測	SQUID001200A
29.	高強度多功能 X 光薄膜微區繞射儀	XRD001900
30.	單晶 X-光繞射儀	XRD003100
31.	單晶 X-光繞射儀-高壓量測服務	XRD003100A
32.	高溫二維 X-ray 廣角繞射儀(粉末 X 光二維繞射&低掠角薄膜 X 光繞射儀)	XRD005100